

第34回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム

第9回集積化MEMSシンポジウム

優秀ポスター賞

小西 敏文, 佐布 晃昭, 年吉 洋,
山根 大輔, 曾根 正人, 益 一哉, 町田 克之 殿

積層メタル技術を用いたMEMS慣性センサの
構造設計のための粘性定数モデルの検討

(社) 応用物理学会集積化MEMS技術研究会主
催, 集積化MEMSシンポジウムにおいて発表され
た貴台の研究発表は, 審査の結果, 優秀ポスター
賞に値するものと認め, ここに表彰します。

平成30年3月18日

(社) 応用物理学会

集積化MEMS技術研究会運営委員会

委員長 有本 和民

